#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005年7月14日(14.07.2005)

PCT

### (10) 国際公開番号 WO 2005/064351 A1

(51) 国際特許分類7: G01R 1/06, 1/067, 1/073, H01L 21/66

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016763

(22) 国際出願日:

2004年11月11日(11.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-430400

2003年12月25日(25.12.2003)

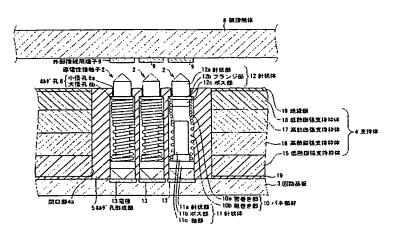
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本 発条株式会社 (NHK SPRING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 2360004 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目10番地 Kanagawa (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 斎藤 慎二 (SAITOU, Shinji) [JP/JP]; 〒2360004 神奈川県横浜 市金沢区福浦3丁目10番地 日本発条株式会社内 Kanagawa (JP). 風間 俊男 (KAZAMA, Toshio) [JP/JP]; 〒3994301 長野県上伊那郡宮田村3131番地日 本発条株式会社内 Nagano (JP). 長屋 光浩 (NAGAYA, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒3994301 長野県上伊那郡宮田村 3 1 3 1 番地 日本発条株式会社内 Nagano (JP).
- (74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1000013 東京 都千代田区霞が関三丁目2番6号 東京倶楽部ビル ディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: CONDUCTIVE CONTACT HOLDER, CONDUCTIVE CONTACT UNIT AND PROCESS FOR PRODUCING CON-**DUCTIVE CONTACT HOLDER** 

(54) 発明の名称: 導電性接触子ホルダ、導電性接触子ユニットおよび導電性接触子ホルダの製造方法



- 8... BODY TO BE TOUCHED
- 9... EXTERNAL CONNECTION TERMINAL
  2... CONDUCTIVE CONTACT
  8... HOLDER HOLE
  6a... SMALL DIAMETER HOLE

- 6b... LARGE DIAMETER HOLE 12a.11a... NEEDLE-LIKE PART 12b... FLANGE PART
- 12c... BOSS PART
- 12... NEEDLE-LIKE BOOY
- 15.18... LOW THERMAL EXPANSION SUPPORTING FRAME 18.17... HIGH THERMAL EXPANSION SUPPORTING FRAME
- 19... INSULATING FILM
- 4... SUPPORT
- 3... CIRCUIT BOARD 10... SPRING MEMBER 10a... DENSE WINDING PART
- 10b ... COARSE WINDING PART
- 11b... BOSS PART 11c... SHAFT PART
- 11... NEEDLE-LIKE BODY
- 13... ELECTRODE 5... HOLDER HOLE FORMING PART

(57) Abstract: A support (4) for holding a conductive contact holder (1) has a structure of stacking low-thermal-expansion supporting frames (15, 18) having a linear expansion coefficient smaller than that of a body (8) to be touched, and high-thermal-expansion supporting frames (16, 17) having a linear expansion coefficient larger than that of the body (8) to be touched. With such a stack structure, linear expansion coefficients of the body (8) to be touched and the entire support (4) can be approximated, and positional deviation can be suppressed between a conductive contactor (2) and an external connection terminal (9) even under high temperature conditions.

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

## — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 導電性接触子ホルダ (1) を保持する支持体 (4) が、被接触体 (8) の線膨張係数よりも低い線膨張係数を有する低熱膨張支持枠体 (15、18) および被接触体 (8) の熱膨張係数よりも高い線膨張係数を有する高熱膨張支持枠体 (16、17) を積層した構成を有する。かかる積層構造を採用することによって、被接触体 (8) の線膨張係数と、支持体 (4) 全体の線膨張係数とを近似させることが可能となり、高温条件下でも導電性接触子 (2) と外部接続用端子 (9) との間で位置ずれが生じることを抑制することが可能である。